04;07;12 Эксиплексно-галогенные широкополосные лампы на смесях инертных газов с молекулами хлора и фреона-12

© А.К. Шуаибов, И.В. Шевера

Ужгородский национальный университет, 88000 Ужгород, Украина e-mail: ishev@univ.uzhgorod.ua

(Поступило в Редакцию 21 ноября 2006 г.)

Представлены результаты исследований спектральных характеристик эффективных коротковолновых источников излучения на переходах моногалогенидов аргона, криптона и ксенона, а также молекул хлора с возбуждением продольным тлеющим разрядом низкого давления. При использовании в лампах комплексных рабочих смесей Ar–Kr–(Xe)–Cl₂ было оптимизировано излучение молекул ArCl*, KrCl*, XeCl*, Cl₂** и Cl₂* в спектральном диапазоне 170–350 nm. Средняя мощность излучения ламп находилась в диапазоне 1–10 W при КПД \leq 25%. На смесях гелия с молекулами хлора и фреона-12 проведена оптимизация широкополосных ламп на переходах молекулы хлора и продуктов распада молекул фреона-12 (CF₂Cl₂). Это позволило создать лампы, излучающие в спектральном диапазоне 140–270 nm и не содержащие в составе рабочих смесей дорогостоящие инертные газы (Xe, Kr).

Эксиплексно-галогенные лампы с широкополосным спектром излучения в ВУФ–УФ-диапазоне представляют интерес для применения в спектрометрах при исследовании поглощения в качестве источника зондирующего излучения, а также в химии высоких энергий, экологии и медицине.

PACS: 85.60.Jb

Введение

Тлеющий разряд постоянного тока в смесях тяжелых инертных газов (R — Ar, Kr, Xe) с галогеносодержащими молекулами систематически исследуется уже в течение последних 25 лет [1], что обусловлено широким использованием такой плазмы в химии высоких энергий и микроэлектронике [2]. На начальном этапе работы эти исследования ограничивались в основном изучением электронных кинетических коэффициентов в тлеющем разряде на смесях $R-F_2(Cl_2)$. Впервые интенсивное излучение молекул XeCl в непрерывном режиме было получено в тлеющем разряде низкого давления при смешивании газовых потоков [3].

На высокую эффективность образования молекул XeCl в непрерывном режиме возбуждения тлеющим разрядом при газостатических условиях впервые было обращено внимание в 1992 г., что позволило получить мощность излучения на $\lambda = 308$ nm, равную 8 W [4]. В настоящее время созданы отпаянные лампы постоянного тока, излучающие на полосах молекул KrCl и XeCl с длиной плазменной среды до 4 m и мощностью излучения — 1.6 kW (222 nm KrCl)–1.1 kW (308 nm XeCl) [5]. В подобных, а также в ряде менее мощных (но в некоторых случаях более эффективных) лампах использовались преимущественно простые рабочие смеси вида $Kr(Xe) - Cl_2(NF_3)$ [6,7]. Спектральная ширина излучения базовой полосы в таких лампах не превышала 5 – 10 nm. Переход от одной длины волны излучения к другой в подобных источниках излучения требует замены газовой смеси или (для отпаянных ламп) замены самой лампы. При применении в спектрометрах, где исследуется поглощение в УФ–ВУФ-диапазоне длин волн, необходимо использование широкополосных излучателей. Для селективного действия на разные молекулярные связи с энергией 4–10 eV химически или биологически активных соединений и для других применений необходимы простые и довольно мощные лампы, излучающие в виде широких $(\Delta \lambda = 30-150 \text{ nm})$ УФ–ВУФ-полос. Такие газоразрядные УФ-ВУФ-лампы могут быть разработаны на основе сложных рабочих смесей, которые включают разные атомы тяжелых инертных газов и различные молекулыгалогеноносители. Эмиссионные характеристики такой плазмы, получаемой с помощью продольного тлеющего разряда низкого давления, исследованы мало.

Одновременное образование моногалогенидов инертных газов изучалось при средних и атмосферных давлениях в разряде переменного тока через диэлектрик (газоразрядная индикаторная панель) [8–10] и поперечном объемном разряде субмикросекундной длительности [11,12].

В настоящей работе обобщаются результаты разработки и оптимизации широкополосных эксиплексногалогенных УФ-ВУФ-излучателей с возбуждением продольным тлеющим разрядом на смесях инертных газов с хлорсодержащими молекулами.

Методика, техника и условия эксперимента

Для исследования эмиссионных характеристик плазмы, которая формировалась в продольном тлеющем разряде, использовалась экспериментальная установка, схема которой приведена на рис. 1. Она состояла из



Рис. 1. Схема установки для исследования широкополосных эксиплексно-галогенных ламп: 1 — буферная камера, 2 — окна из кварца, 3 — разрядная трубка, 4 — электроды, 5 — балластное сопротивление, 6 — высоковольтный выпрямитель, 7 — миллиамперметр, 8 — киловольтметр, 9 — вакуумный спектрометр, 10 — окно из LiF, 11 — диафрагма, 12 — фильтр, 13 — измеритель мощности спонтанного излучения "Кварц-01", 14 — вакуумная и газосмесительная системы, 15 — вакуумный кран.

вакуумного монохроматора (или монохроматора МДР-2 с дифракционной решеткой 1200 str/mm), разрядных трубок, измерителей тока разряда, спада напряжения на электродах излучателя и абсолютной мощности УФ-ВУФ-излучения. В эксперименте проводились исследования вольт-амперных характеристик (ВАХ) тлеющего разряда, мощности, которая вкладывается в разряд $(W_{\rm el} = I_{\rm ch} \cdot U_{\rm ch},$ где $I_{\rm ch}$ — ток тлеющего разряда, а $U_{\rm ch}$ — спад напряжения на электродах лампы), спектральных характеристик излучения плазмы в диапазоне 120-350 nm, зависимостей яркости излучения молекулярных полос от величины давления и парциального состава рабочих смесей, абсолютной мощности УФ-ВУФизлучения лампы (W_{emm}) и ее коэффициента полезного действия (КПД) ($\eta = W_{\rm emm}/W_{\rm el} \cdot 100\%$). Спектры излучения в большинстве случаев корректировались на величину относительной спектральной чувствительности системы "монохроматор + фотоумножитель". Величина яркости спектральной полосы, под которой понималась площадь под соответствующей кривой на диаграмной ленте, также определялась с учетом спектральной чувствительности системы регистрации излучения. Спектры регистрировались с помощью фотоумножителей ФЭУ-142 и ФЭУ-106.

Средняя мощность излучения лампы со всей поверхности разрядной трубки определялась по фотометрической методике [13,14].

Тлеющий разряд зажигался в цилиндрических разрядных трубках из высококачественного кварца. Исследование оптических характеристик широкополосных излучателей на основе монохлоридов Ar, Kr и Xe, а также молекул Cl_2^{**} , Cl_2^{*} проводилось в узкой разрядной трубке с открытыми торцами, установленной в буферной камере объемом 101. Камера была герметически состыкована через LiF-окно с вакуумным монохроматором (рис. 1). В этом случае применялись разрядные трубки с внутренним диаметром 0.5 cm и расстоянием между анодом и катодом 10 cm. Электроды были изготовлены из листового никеля и имели одинаковую цилиндрическую форму (длиной 1 cm). Тлеющий разряд в трубке поджигался при помощи высоковольтного выпрямителя $(U < 30 \, \text{kV}; I < 100 \, \text{mA}).$

Кроме плазмы положительного столба представляют интерес для использования в эксиплексно-галогенных излучателях постоянного тока и другие области тлеющего разряда. Исследование характеристик излучателей на молекулах хлора [15] и хлорида криптона [16] проводилось также в вольерном разряде (рис. 2). В таком типе разряда возможно формирование отрицательного катодного свечения большой площади, яркость излучения которого в несколько раз больше, чем яркость излучения плазмы положительного столба продольного тлеющего разряда [17]. Место для формирования положительного столба в вольерном разряде отсутствует. Электроды вольерного разряда состояли из четырех катодных и четырех анодных стержней длиной 15.6 и диаметром 0.3 ст. Они равномерно устанавливались по поверхности цилиндра диаметром 3 ст. Постоянное напряжение подавалось на аноды через балластное сопротивление 1 kΩ, а все катоды заземлялись. Система электродов вольерного разряда была установлена в разрядной камере объемом 101. Рабочие смеси предварительно готовились в вакуумной газосмесительной системе и напускались в разрядную камеру или кварцевую трубку.



Рис. 2. Схема непрерывной УФ-ВУФ-лампы с накачкой вольерным разрядом: 1 — катоды, 2 — аноды, 3 — плазма отрицательного катодного свечения, 4 — балластное сопротивление, 5 — высоковольтный выпрямитель, 6 — разрядная камера, 7 — диэлектрический фланец.

95

Излучатели на димерах хлора и продуктах диссоциации молекул фреона-12 (CF,CI,)

Перспективность использования смеси He-Cl₂ в импульсных многоволновых излучателях была установлена раньше при возбуждении этой смеси поперечным обьемным разрядом малой длительности [18–20]. В таких рабочих средах отсутствуют дорогостоящие тяжелые инертные газы, что создает условия для работы в режиме медленной прокачки рабочей смеси. При этом возможны длительная работа УФ-ВУФ-излучателя и повышение его энергетических параметров.

Тлеющий разряд в смесях He–Cl₂ (CF₂Cl₂) существовал в достаточно однородном состоянии только при общем давлении рабочей смеси $P \leq 3-4$ и $P(Cl_2) \leq 1$ kPa. Диаметр плазмы шнура уменьшался с увеличением $P(Cl_2, CF_2Cl_2)$ от 3 до 1 mm. Контрагирование разряда хотя и приводит к уменьшению боковой поверхности цилиндрического плазменного излучателя, но является наиболее простым способом изоляции разряда от контакта со стеклянной разрядной трубкой. Это предотвращает потери галогеноносителя на диффузию в кварц при сильном нагревании трубки ("жестчание" газовой смеси [21]).

Вольерный разряд на смесях $He(Kr)-Cl_2$ устойчиво зажигался при давлении газовых смесей 100-1500 Ра и существовал в форме четырех катодных плазменных образований длиной по 15.6 и диаметром 0.5-1.0 ст. Формирование общей области отрицательного катодного свечения во внутренней части системы электродов вольерного разряда не наблюдалось. Поэтому данную область в коаксиальной лампе можно применить в системах очистки питьевой воды или получения озона, где рабочее вещество прокачивается в средней части плазмохимического реактора.

Типичные ВАХ тлеющего разряда (рис. 3) при $I_{\rm ch} \leq 10~{\rm mA}$ имели форму, которая соответствует его поднормальной стадии, а при более высоких токах разряд переходил в нормальный режим горения. Возрастание парциального давления хлора и общего давления смеси He-Cl₂ приводило к значительному увеличению потенциала зажигания разряда и величины $U_{\rm ch}$ в нормальном режиме горения разряда. Для разряда в фреоне-12 при увеличении давления CF₂Cl₂ от 130 до 670 Ра квазистационарная величина напряжения увеличивалась с 1.7 до 2.5, а потенциал зажигания — от 2.0 до 3.5 kV [22]. Величина мощности, вкладываемая в плазму, увеличивалась с ростом давления фреона-12 и достигала 45-65 W.

ВАХ вольерного разряда больше соответствовали аномальной стадии тлеющего разряда, хотя в смеси $\rm Kr-Cl_2$ фиксировался поднормальный (при $I_{\rm ch} \leq 80~\rm mA)$ и нормальный (80–160) режимы горения. Электрическая мощность вольерного разряда (при $U_{\rm ch} \leq 1~\rm kV)$ линейно возрастала с увеличением тока и достигала



Рис. 3. Вольт-амперные характеристики тлеющего разряда на смеси $\text{He}-\text{Cl}_2(a)$ и вольерного разряда на смесях $\text{He}(\text{Kr})-\text{Cl}_2(b)$: $P(\text{He})-P(\text{Cl}_2) = 130-30$ (1), 130–70 (2), 130–130 (3), 400–20 (4), 670–20 (5) и 2000–20 (6) Ра (a); $P(\text{He})-P(\text{Cl}_2) = 670-130$ (1), $P(\text{Kr})-P(\text{Cl}_2) = 270-130$ (2) Ра (b).

125 W. Система электродов при $I_{\rm ch} \leq 300$ mA значительно не нагревалась, так как энергия, которая терялась на образование быстрых нейтральных частиц, в вольерном разряде значительно ниже по сравнению с продольным тлеющим разрядом. Поэтому такие излучатели не требуют принудительного водяного охлаждения при $I_{\rm ch} \leq 300$ mA.

Спектры излучения плазмы на основе смесей $He-Cl_2(CF_2Cl_2)$ представлены на рис. 4. В спектрах излучения тлеющего разряда наблюдаются широкие полосы 258 nm $Cl_2(D' - A')$, 160–195 nm $Cl_2(^1\Sigma - ^1\Pi)$ и максимум излучения молекул хлора при 200 nm. Половина мощности излучения такой плазмы сконцентрирована в ВУФ-области спектра. Основной особенностью спектров излучения плазмы на основе фреона-12 является наличие яркого максимума в спектральном диапазоне 140–170 nm проявляющегося на фоне излучения полос хлора и состоящего из спектральных линий иона Cl^+ . Наличие интенсивных спектральных линий ионов Cl^+ косвенно подтверждает ион-ионный характер плазмы контрагированного разряда. В этом случае одним из основных процессов образования возбужденных моле-



Рис. 4. Спектры излучения плазмы тлеющего (a) и контрагированных разрядов (b) в смесях гелия с молекулами хлора $P(\text{He})-P(\text{Cl}_2) = 530-130 \text{ Pa}$ (a), и фреона-12 P(He)- $-P(\text{CF}_2\text{Cl}_2) = 130-40$ (b), Pa.

кул хлора может быть реакция

$$Cl^{-} + Cl^{+} + (He) \rightarrow Cl_{2}^{**} + (He).$$
 (1)

Таким образом, видно, что плазма на основе тлеющего (в том числе и вольерного) разряда, излучает единую широкую полосу в пределах 160–270 nm, а основное излучение плазмы контрагированного разряда в фреонсодержащих средах сконцентрировано в спектральном диапазоне 130–270 nm.

Для стадии более или менее однородного тлеющего разряда, когда давление рабочей смеси не превышало 1.5-2.0 kPa, оптимальное давление гелия составляло P(He) = 0.6-0.7 kPa, а для контрагированного разряда — 60 kPa (рис. 5, *a*). Из этого следует, что удельная яркость излучения ион-ионной плазмы контрагированного разряда в смеси He-Cl₂ существенно превышает яркость УФ-ВУФ-излучения однородной стадии тлеющего разряда. Яркости излучения полос 258 и 200 nm примерно равны между собой на однородной стадии разряда,

а для плазменного шнура яркость полосы 258 nm в 2.5–3.0 раза выше яркости полосы 200 nm. Оптимальное содержание хлора в разряде — 0.6–1.0 kPa. В разряде на смеси $P(\text{He})-P(\text{Cl}_2) = 1.33-0.53$ kPa зависимость яркости излучения полосы 258 nm от величины тока была линейно возрастающей, а для полосы 200 nm она приходила в насыщение при $I_{ch} \ge 20$ mA. Для разряда в смеси $P(\text{He}) - P(\text{Cl}_2) = 4.0 - 2.0$ kPa при $I_{ch} = 20-25$ mA наблюдался скачкообразный переход тлеющего разряда в контрагированное состояние. При этом яркость полосы 258 nm продолжала увеличиваться с ростом тока, а яркость полосы 200 nm приходила в насыщение и уменьшалась. Величина полной мощности УФ-ВУФ-излучения лампы достигала 3 W при КПД $\le 5\%$.

Результаты оптимизации яркости УФ-ВУФ-излучения в зависимости от парциального состава смеси He-– CF_2Cl_2 представлены на рис. 6. Для плазмы на основе фреона-12 соответствующие данные приведены в работе [22]. Оптимальная величина $P(CF_2Cl_2)$ находилась



Рис. 5. Зависимости яркости излучения полос 200 nm $\text{Cl}_2^{**}(1)$, 258 nm $\text{Cl}_2(D' - A')(2)$ и суммарной яркости УФ-излучения плазмы тлеющего разряда в смеси He-Cl₂ (3) от парциального давления гелия при $P(\text{Cl}_2) = 200$ (*a*) и хлора при P(He) = 1330 Pa (*b*).

Журнал технической физики, 2007, том 77, вып. 9



Рис. 6. Зависимость яркости излучения плазмы контрагированного разряда в смеси He–CF₂Cl₂ от парциального давления гелия при $P(CF_2Cl_2) = 40$ Pa (b) в спектральных диапазонах 130–175 (1, 1'), 175–215 (2, 2'), 215–280 (3, 3') и суммарной яркости в спектральном диапазоне 130–280 nm (4, 4').

в диапазоне 300–500 Ра. Наиболее чувствительным к содержанию фреона-12 в смеси было излучение ионов Cl^{+*} (рис. 6, *a*). Оптимальное давление гелия в смеси находилось в пределах 5–6 kPa. Увеличение тока разряда от 2 до 30 mA приводило к возрастанию яркости излучения молекул хлора и спектральных линий ионов хлора. При работе в газостатическом режиме (без применения горячей пассивировки лампы в фреоне-12) наибольшим ресурс излучения разряда в смеси $P(\text{He}) - P(\text{CF}_2\text{Cl}_2)$ был на $\lambda = 200$ nm ($t_p \ge 1$ h при $I_{ch} = 20$ mA). При скорости продольной прокачки 0.03–0.3 l/min была возможно устойчивая работа излучателя в течение нескольких десятков часов. Средняя мощность излучения в спектральном диапазоне 130–280 mm достигала 1.5–2 W при КПД $\le 3\%$.

Для вольерного разряда в смеси $\text{He}-\text{Cl}_2$ наиболее оптимальными были смеси P(He) = 1.2-1.5и $P(\text{Cl}_2) = 0.3-0.4$ kPa. Величина средней мощности УФ-ВУФ-излучения с одного катодного стержня достигала 1 W при КПД = 4%.

Эксиплексно-галогенные излучатели низкого давления на смесях аргона, криптона и ксенона с молекулами хлора

Продольный тлеющий разряд в смесях $Ar(Kr, Xe)-Cl_2$ существовал в виде слаботочной и сильноточной стадий, переход между которыми происходил в форме скачка при $I_{ch} = 1-2$ mA. ВАХ тлеющего разряда и их поведение в зависимости от состава и давления рабочих смесей были близкими к ВАХ разряда на смеси $He-Cl_2$. Мощность, вкладываемая в разряд, находилась в пределах 5–40 W.

Спектры излучения лампы на смесях тяжелых инертных газов с молекулами хлора представлены на рис. 7. Они состояли из сильно уширенных полос молекул ArCl(B-X), KrCl(D, B-X), XeCl(D, B-X) и $Cl_2(D'-A')$. За счет значительного перекрытия все полосы излучения сливались в единый континуум в диапазоне 170-320 nm с максимумами 175-200-308 (смесь Ar-Cl₂), 199-222-258 (смесь Kr-Cl₂), 236-308 (смесь Xe-Cl₂) и 175-199-222-258 nm (смесь Al-Kr-Cl₂) [23-26]. Спектр излучения лампы на четвертой смеси более равномерно перекрывал спектральный диапазон 170-320 nm и, по сравнению с рис. 7, d, имел еще дополнительные максимумы при $\lambda = 236$ и 308 nm. Основной причиной формирования широкополосного излучения на основе полос монохлоридов Ar, Kr и Xe, а также молекул хлора в тлеющем разряде на сложных рабочих смесях низкого давления является малая скорость процесса колебательной релаксации в пределах D и B состояний эксиплексной молекулы и возбужденных состояний молекулы хлора [27].

Для оптимизации работы широкополосной эксиплексно-галогенной лампы спектральный диапазон 170-320 nm условно разделялся на отдельные составляющие с максимумами в области кантов полос и учетом формы отдельной электронно-колебательной полосы так, что при их сшивке получались исходные спектры. Распределение парциальных составляющих яркости излучения для тройных аргонсодержащих смесей было следующим: 175 (15%), 199 (17), 222 (44), 258 (24), (смесь $P(Ar) - P(Kr) - P(Cl_2) = 1.33 - 0.4 - 0.6 \text{ kPa}$) и 175 (23%), 200 (10), 236 (13), 258 (30) и 308 nm (24) (смесь $P(Ar) - P(Xe) - P(Cl_2) = 2.8 - 1.2 - 0.16 \text{ kPa}$). При использовании в рабочей среде криптора и ксенона $P(Kr) - P(Xe) - P(Cl_2) = 2.8 - 1.2 - 0.6 \text{ kPa}$ (смесь парциальный вклад отдельных составляющих в яркость континуума была таким: 199 (5%), 222 (11), 236 (8), 258 (12) и 308 nm (64). Для лампы на основе четырехкомпонентной (Ar-Kr-Xe-Cl₂) смеси было получено следующее распределение парциальных составляющих континуума в спектральном диапазоне 170-320 nm: 175 (5%), 200 (6), 222 (11), 236 (9),258 (16) и 308 nm (53).



Рис. 7. Спектры излучения широкополосных эксиплексно-галогенных ламп постоянного тока на смесях $Ar-Cl_2(a)$, $Kr-Cl_2(b)$, $Xe-Cl_2(c)$ и $Ar-Kr-Cl_2(d)$.

Результаты оптимизации рабочих сред эксиплексногалогенных излучателей на двойных смесях представлены на рис. 8 и 9. Оптимальное парциальное давление хлора находилось в диапазоне 250-320 Ра. Вклад яркости излучения полосы 236 nm XeCl(D-X) в суммарную яркость УФ-излучения лампы на смеси Xe-Cl₂ достигал 10-20% (рис. 9). Оптимальное парциальное давление Ar, Kr и Xe в двойных смесях увеличивалось при уменьшении атомного веса атома инертного газа и находилось в диапазоне 2-4 kPa. Оптимальная величина P(Ar), необходимая для получения максимальной яркости полос 200 и 258 nm в тлеющем разряде на смеси Ar-Cl₂, была равна 2 kPa (рис. 9). Максимальная скорость увеличения яркости излучения полос ArCl и Cl^{*} получена в диапазоне разрядных токов 1-4 mA (поднормальный режим горения разряда) (рис. 10). При больших разрядных токах наблюдалась линейная зависимость яркости полос излучения от величины тока.

Зависимость яркости излучения основных полос из плазмы тлеющего разряда в смеси $Ar-Kr-Cl_2$ от величины парциального давления Ar и Kr приведена на рис. 11. Яркости полос KrCl(B-X) и $Cl_2(D'-A')$

были примерно равны между собой и в 2.0-2.5 раза превышали яркость излучения полос KrCl(D-X) и ArCl(B-X). Оптимальное значение P(Ar) находилось в диапазоне 2.5-3.5, а для полосы 199 nm оно было равным 4.0 kPa. При увеличении содержания криптона в смеси $Ar-Kr-Cl_2$ наблюдалось возрастание яркости полос 258 и 222 nm, а для полосы 175 nm ArCl(B-X) максимум яркости получен при P(Kr) = 0.5 kPa. Дальнейшее увеличение парциального давления криптона в смеси приводило к уменьшению яркости излучения полосы 175 nm.

Для излучателей на смесях Ar-Xe-Cl₂, Kr-Xe-Cl₂ оптимальное парциальное давление хлора находилось в диапазоне 150–300 Ра, а оптимальная величина $P(Ar) \leq 1.33$ kPa. Соотношение парциальных давлений тяжелых инертных газов, при котором в формировании широкополосного УФ-ВУФ-излучения принимают участие разные эксиплексные молекулы и молекулы хлора, было таким: P(Ar) - P(Xe) = 30 - (1 - 3)и P(Kr) - P(Xe) = (10 - 15) - (3 - 4). Для смеси Ar-- Kr-Xe-Cl₂ оптимальная величина общего давления не превышала 2 kPa, а значения P(Kr) и



Рис. 8. Зависимость яркости излучения полос XeCl(D, B-X) и суммарной яркости лампы в спектральном диапазоне 180–340 nm от величины парциального давления хлора при P(Xe) = 2.0 kPa (*a*) и парциального давления ксенона при $P(Cl_2) = 80 \text{ Pa}$ (*b*): 236 (*I*), 308 (*2*) и $\Delta \lambda = 180-340 \text{ nm}$ (*3*) (*I*_{ch} = 8 mA).



Рис. 9. Зависимость яркости излучения полос 175 (1), 200 (2) и 258 nm (3) от величины парциального давления аргона в разряде на смеси $Ar-Cl_2$ при $P(Cl_2) = 0.4$ kPa и $I_{ch} = 10$ mA.

P(Xe) находились в диапазоне 100–250 Ра. Распределение яркости излучения разряда в четверной смеси было наиболее чувствительным к величине P(Xe). Близким к оптимальному было соотношение P(Kr) - P(Xe) = (2.0-2.5) - (1.0-1.5).

В лампах на основе сложных газовых смесей важную роль играют реакции замещения

$$\operatorname{ArCl}^* + \operatorname{Kr}(\operatorname{Xe}) \to \operatorname{KrCl}^*(\operatorname{XeCl}^*) + \operatorname{Ar},$$
 (2)

$$KrCl^* + Xe \rightarrow XeCl^* + Kr$$
 (3)

и процессы передачи энергии $Ar(m) \rightarrow Kr, Xe;$ $Kr(m) \rightarrow Xe$. Величина константы скорости таких реакций может достигать 10^{-9} cm³/s [29–31], поэтому значительная часть эксиплексных молекул в плазме образуется в непрямых процессах.

Средняя мощность излучения ламп на двойных газовых смесях находится в пределах 2-8 W при КПД 7-21%. Наиболее эффективной была смесь $P(Xe) - -P(Cl_2) = 3.6-0.16$ Ра. Широкополосные эксиплексногалогенные излучатели на сложных смесях типа $Ar-Kr-Xe-Cl_2$ по мощности излучения (6 W) и КПД ($\eta \le 25\%$) близки к характеристикам ламп на смеси $Xe-Cl_2$, но они позволяют более равномерно перекрывать спектральный диапазон 170-320 nm и более экономно расходовать дорогостоящие инертные газы (Kr, Xe).

В излучателе на смеси $Ar(Xe)-Cl_2$ -воздух за счет использования излучения полос молекул азота ($\lambda = 227$, 237 и 247 nm третья система Каплана и четвертая позитивная система молекулы азота) было достигнуто более однородное перекрытие спектрального диапазона 200–270 nm. Наиболее оптимальной была смесь $P(Ar) - P(Xe) - P(Cl_2) - воздух = 6.0 - 0.8 - 0.08 - 0.01$ kPa. При увеличении парциального давления хлора до 250–300 Pa в спектрах излучения плазмы оставались только полосы эксиплексных молекул и хлора.

Рассмотрим кратко основные характеристики лампы с накачкой вольерным разрядом постоянного тока. Увеличение P(Kr) в вольерном разряде на смеси $Kr-Cl_2$ от 250 до 550 Ра приводило к возрастанию



Рис. 10. Зависимость яркости излучения лампы на смеси $P(\text{Ar})-(\text{Cl}_2) = 4.0-0.16$ kPa: 175 (1), 200 (2) и 258 nm (3) от величины тока тлеющего разряда.



Рис. 11. Зависимости яркости полос излучения 175 (1), 199 (2), 222 (3) и 258 nm (4) от величины P(Ar) в тлеющем разряде на смеси $P(Ar) - P(Kr) - -P(Cl_2) = P(Ar) - 0.40 - 0.16 kPa$ (a) и полос 175 (1), 222 (2), 258 nm (3) от P(Kr) в разряде на смеси $P(Ar) - P(Kr) - P(Cl_2) = 6.0 - P(Kr) - 0.08 kPa$ (b).

яркости полосы 222 nm KrCl(B-X), а яркость полосы 258 nm Cl₂(D'-A') при этом уменьшалась. Зависимости яркости полос KrCl* и Cl₂* от величины разрядного тока в диапазоне 10–300 mA были линейно возрастающими. Наиболее оптимальной была газовая смесь $P(Kr) - P(Cl_2) = (500-700) - (200-270)$ Pa. Средняя мощность УФ–ВУФ-излучения с одного катодного стержня достигала 3 W при КПД $\leq 10\%$.

Заключение

Из состояния разработок эксиплексно-галогенных излучателей с возбуждением продольным тлеющим разрядом следует, что исследование характеристик ламп на 175 nm ArCl* и широкополосных ламп на комплексных рабочих средах типа Ar–Kr–Xe–Cl₂ не проводилось, а в галогенных лампах на смесях He–Cl₂(CF₂Cl₂) во внимание принималось только излучение полосы 258 nm Cl₂(D'-A'). Разработанные лампы излучали преимущественно на одной полосе B-X молекулы RX^* . Для довольно большого количества применений в спектроскопии, химии высоких энергий и экологии важным является получение излучения во всем (или его части) спектральном диапазоне 170–320 nm, поскольку водородные лампы имеют слишком низкий КПД, а доля УФ– ВУФ-излучения в ксеноновых и кластерных лампах в данном спектральном диапазоне также небольшая.

На основании уширения полос излучения эксиплексных молекул и молекул хлора при низком давлении рабочих смесей, что связано с замедлением колебательной релаксации в пределах возбужденных состояний молекул и замеделением релаксации заселенности высоколежащих состояний молекул, а также с применением комбинации разных рабочих и галогенсодержащих газов были разработаны простые широкополосные эксиплексно-галогенные излучатели.

Экспериментально установлено, что спектральный диапазон излучателей на смесях $He-Cl_2-(CF_2Cl_2)$ может быть расширен с 240 до 160(130) nm, а мощность и КПД лампы могут быть увеличены примерно в два раза. В фреонсодержащих средах контрагированного разряда важную роль играет излучение ион-ионной плазмы, так как наиболее коротковолновая часть спектра излучения лампы формируется излучением ионов Cl^{+*} , а образование возбужденных молекул хлора в токовом канале может происходить в реакции рекомбинации положительных и отрицательных ионов хлора.

Установлены основные характеристики широкополосной лампы постоянного тока на монохлоридах тяжелых инертных газов и молекулах хлора: базовые длины волн полос излучения 175, 199, 200, 222, 236, 258 и 308 nm позволяют формировать континуум в спектральном диапазоне 170–320 nm; полная мощность излучения такой лампы находится в диапазоне 2–8 W при КПД \leq 25%; комплексные рабочие среды типа Ar–Kr–Xe–Cl₂ по мощности излучения и КПД приближаются к выходным характеристикам лампы на смеси Xe–Cl₂; максимальная эффективность излучателя достигалась в поднормальном режиме горения разряда (при $I_{ch} \leq 5$ mA).

Плазма отрицательного катодного свечения вольерного разряда в смесях инертных газов с хлором является мощным и достаточно эффективным источником широкополосного УФ–ВУФ-излучения в спектральном диапазоне 190–260 nm; лампа излучает с мощностью 10-12 W при КПД $\leq 10\%$ и не требует принудительного водяного охлаждения. Перспективным является также использование приэлектродных слоев поперечного высокочастотного разряда, у которого на переходе "плазмаслой" в галогенсодержащих средах формируется ионионная плазма, где эффективность образования эксиплексных молекул примерно на порядок выше, чем в плазме положительного столба.

Исходя из близости свойств продольного тлеющего разряда постоянного тока и емкостного разряда [5] полученные результаты по оптимизации УФ-ВУФизлучателей низкого давления на хлоридах инертных газов и молекул хлора могут быть распространены и на аналогичные рабочие среды эксиплексно-галогенных ламп с возбуждением емкостным разрядом. Это позволит значительно увеличить ресурс работы УФ-ВУФ-излучателей, но излучение в этом случае будет импульсным, а не постоянным.

Список литературы

- [1] Зайцев В.В. // Опт. и спектр. 1992. Т. 72. Вып. 4. С. 859–870.
- [2] Данилин Б.С., Киреев В.Ю. Применение низкотемпературной плазмы для травления и очистки материалов. М.: Энергоатомиздат, 1987. С. 45–63.
- [3] Михкельсоо В.Т., Трещалов А.Б., Пеэт В.Э., Ялвисте Э.Х. // Квантовая электроника. 1987. Т. 14. № 7. С. 1404–1406.
- [4] Головицкий А.П. // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 24. Вып. 8. С. 73–76.
- [5] Ломаев М.И., Скакун В.С., Соснин Э.А., Тарасенко В.Ф. // УФН. 2003. Т. 173. № 2. С. 201–217.
- [6] Головицкий А.П., Кан С.Н. // Опт. и спектр. 1993. Т. 75. № 3. С. 604-609.
- [7] Бойченко А.М., Панченко А.Н., Тарасенко В.Ф., Яковленко С.И. // Квантовая электроника. 1996. Т. 23. № 5. С. 3–5.
- [8] Шуаибов А.К., Шевера В.С. // ЖТФ. 1979. Т. 49. Вып. 4. С. 1747–1748.
- [9] Шевера В.С., Шуаибов А.К. // ЖТФ. 1980. Т. 50. Вып. 4. С. 728–736.
- [10] Шуаибов А.К., Шевера В.С., Герц С.Ю., Малинин А.Н. // Укр. физ. журн. 1983. Т. 28. Вып. 12. С. 1808–1813.
- [11] Шуаибов А.К., Шимон Л.Л., Шевера И.В. // ПТЭ. 1998. № 3. С. 142–144.
- [12] Шуаибов А.К., Дащенко А.И. // ПТЭ. 2000. № 3. С. 101–103.
- [13] *Гуревич М.М.* Фотометрия: теория, методы и приборы. Л.: Энергоатомиздат, 1983.
- [14] Шуаибов А.К., Шимон Л.Л., Дащенко А.И., Шевера И.В. // ПТЭ. 2002. № 1. С. 104–106.
- [15] Шуаибов А.К., Дащенко А.И., Шевера И.В. // Письма в ЖТФ. 2002. Т. 28. Вып. 6. С. 23–28.
- [16] Шуаибов А.К., Шимон Л.Л., Дащенко А.И., Шевера И.В. Эксимерно-галогенная лампа с накачкой вольерным разрядом. Патент UA 53509 А. Приоритет от 20.06.2002, опубликован 15.01.2003. Б.И. № 1.
- [17] Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1987.
- [18] Шуаибов А.К. // ТВТ. 2000. Т. 38. № 4. С. 674–676.
- [19] Шуаибов А.К. // ЖТФ. 2000. Т. 26. Вып. 9. С. 1-6.
- [20] Шуаибов А.К., Шимон Л.Л., Дащенко А.И., Шевера И.В. // ЖТФ. 2001. Т. 71. Вып. 2. С. 77.
- [21] Светцов В.И., Максимов А.И., Куприяновская А.П. и др. // Электронная техника. Сер. 1. Электроника СВЧ. 1977. № 7. С. 36–39.
- [22] Шуаибов А.К., Шимон Л.Л., Шевера И.В., Дащенко А.И. // Прикладная физика. 2002. № 2. С. 51–56.
- [23] Шуаибов А.К., Дащенко А.И., Шевера И.В. // ЖПС. 2001. № 2. С. 275–277.
- [24] Шуаибов А.К., Дащенко А.И., Шевера И.В. // Квантовая электроника. 2001. Т. 31. № 4. С. 371–372.
- [25] Шуаибов А.К., Дащенко А.И., Шевера И.В. // ЖТФ. 2001.
 Т. 71. Вып. 8. С. 121–123.

- [26] Шуаибов А.К., Шимон Л.Л., Дащенко А.И., Шевера И.В. Электроразрядная эксимерная лампа низкого давления. Патент UA 47626 А. Приоритет от 28.05.2001, опубликован 15.07.2002. Б.И. № 7.
- [27] Дацюк В.В., Измайлов И.А., Кочелап В.А. // УФН. 1998.
 Т. 168. Вып. 4. С. 410–439.
- [28] Шуаибов А.К., Шимон Л.Л., Дащенко А.И., Шевера И.В. // Тез. докл. III Междунар. науч.-техн. конф. "Фундаментальные и прикладные проблемы физики". Саранск, Россия, 2001. С. 46.
- [29] Шуаибов А.К., Шевера В.С. // Опт. и спектр. 1979. Т. 47. Вып. 2. С. 409–410.
- [30] Брау Ч. Эксимерные лазеры / Под ред. Ч. Роудза. М.: Мир, 1981.
- [31] Cook J.D., Leichner P.K. // Phys. Rev. A. 1991. Vol. 43.
 P. 1614–1617.